鉄多価イオン発光線強度比の電子密度依存性測定

清水恵理奈

平成26年3月6日

1 背景

太陽には未だ解明されていないメカニズムの一 つにコロナ加熱というものがある。太陽内部や表 面は高密度プラズマだがコロナは低密度プラズマ であるため、光球表面から遠ざかるにつれて電子 密度は低くなっていく。しかし電子温度は、光球 表面が約 6000 K に対して遷移領域を過ぎると急 激に上昇してコロナでは 100 万 K となっている。 希薄なプラズマであり太陽表面から離れた距離に あるコロナがなぜ 100 万 K を保っているのか、そ のメカニズムは未だ解明されていない。

太陽コロナは100万Kという高温を保っている ため、そこには鉄多価イオンが多数存在している。 太陽大気の鉄多価イオンスペクトルを調査するこ とは太陽大気における電子密度分布や電子温度分 布を知るために必要であり、その為に太陽大気の 分光計測は重要である。国立天文台は2006年9月 に「SOLAR-B」プロジェクトの太陽観測衛星「ひ ので」を打ち上げている。このひのでには、超高 分解能の可視光磁場望遠鏡 (SOT-FPP,OTA)、極 端紫外線撮像分光装置と X 線電波望遠鏡 (XRT) が搭載されており、3つの波長領域における観測 が可能となっている。今回注目している鉄多価 イオンのスペクトルは主に 5~30 nm の極端紫 外 (EUV: Extreme ultraviolet) 領域で発光するた め、極端紫外線撮像分光装置 (EIS: EUV Imaging Spectrometer)[1] を用いて分光測定が行われ ている。

この EIS を用いたプラズマ診断は、観測された スペクトル強度比をモデル計算と比較することで 診断を行い、太陽大気の電子密度分布の測定を行っ ている。その為、プラズマ診断結果が信頼に値する かどうかはモデル計算の信頼性に大きく左右され る。しかし衝突輻射モデル (CR model: Collisional Radiative model) 計算で使われる放射、電離、再 結合などの速度係数は実験による評価を受けてい ない計算値であることが多く、実際の観測におい て信頼性が十分にあるか分かっていない。 よってモデル計算が信頼に値するのか実験によ る評価が求められている。本研究では過去の研究 [2] においてモデル計算と大きな違いが見られてい る FeXV のスペクトルを観測し再現性を確かめ、 さらにモデル計算との違いが見られる部分につい ての詳細な測定を行った。

2 実験装置

本研究で測定する波長領域は 5 ~ 30 nm の極端 紫外領域 (EUV 領域) である。 $10 \sim 200$ nm の真 空紫外領域 (VUV 領域) と呼ばれる波長領域は大 気中に含まれる N₂ や O₂ の吸収帯となるため、空 気中を伝播することが出来ない。そのため光学系 は真空容器に収められており、真空度は 10^{-8} Pa となっている。

実験装置及び分光器の概略図を図 2.1 に示す。 CoBIT の光源は細長い線上であるため、それ自体 を分光器の入射スリットとみなすことが出来る。そ のためスリットレスな構造を持った分光器となっ ている。このため CoBIT の EUV 分光器では高効 率な測定が可能となっている。また別の観測ポー トに取り付けたピンホールカメラでは電子ビーム 径を測定してトラップ領域における電子密度を求 め、ワイヤープローブ挿入システムは制動放射観 測に利用した。



図 2.1 実験装置及び EUV 分光器の概略図

3.1 鉄スペクトルの観測

図 3.1 は本研究で注目している FeXV23.39 nm と 24.38 nm のラインについての電子ビーム電流 依存性を示したものである。ここでは電子ビーム エネルギー (Ee) を 500 eV に固定し、電子ビーム 電流を Ie= 10, 12, 13, 14, 15 mA と変化させた。 一般に電子ビーム電流を増加させていくとその分 標的となるイオンに衝突する電子の数が増えるた め、生成される多価イオンの数も増加する。同じ 価数の多価イオンによる発光ラインの強度比は Ie によって急激に変化しないと考えられる。しかし 図 3.1 を見ると、Ie を変化させていくことによっ て同じ価数からの発光である FeXV23.39 nm と FeXV24.38 nm の 強度比が 急激に 変化している こ とがわかる。なお図 3.1 の青線は、各スペクトル についてガウシアンフィッティングを行ったもの である。後述する各スペクトル強度比はガウシア ンフィッティングによって求めた。



図 3.1 500 eV における FeXV23.3866 nm と 24.37940 nm の電子ビーム電流依存性

3.2 電子密度測定

対象となるスペクトルの強度を測定すると共に、 位置有感検出器 (PSD: Position Sensitive Detector)を用いてトラップ領域の電子密度を測定した。 電子密度の値を求めるためには電流値、電子ビー ムエネルギーの他にも電子ビームの形状即ち電子 の空間分布とイオンの空間分布を測定しなければ ならない。

電子ビームの衝突によって励起状態となったイ オンは脱励起する際に光を放出する。EUV 領域の 発光は遷移寿命が短い E1 遷移によるものであり、 寿命は10⁻¹⁰ s 程度である。そのため電子が衝突 した直後に発光するので、EUV 領域の発光分布は 電子の空間分布を表していると考えることが出来 る。一方でイオンの空間分布は可視領域の発光分 布から求める。可視領域の発光は基底状態微細構 造間の M1 遷移であるために寿命が長く (~ ms)、 電子ビームの衝突により励起されてもすぐには脱 励起せず、電子ビームの外でも発光すると考えら れる。しかし先行研究[2]より、電子とイオンの 空間分布に大きな差異はないことが分かっている。 そのため今回の測定では電子の空間分布のみを測 定した。図 3.2 は PSD で検出したイメージであ り、青色の部分が EUV 領域の発光を検出してい る部分である。これを横軸方向に積分し空間分布 を表したのが図 3.3 である。電子密度は測定の結 果を以下の式に代入して求めた。

$$\bar{n_e} = \frac{4\ln(2)}{2\pi a^2} \cdot \frac{I}{e\upsilon} \qquad [\text{cm}^{-3}] \qquad (3.1)$$

ここで I は電子ビーム電流、v は電子ビームエ ネルギーより求めた電子の速度、a は EUV 領域の 発光分布の半値全幅であり、ガウシアンフィッティ ングによって求めた。



図 3.2 PSD で観測した EUV 発光分布



図 3.3 エネルギー 500 eV における EUV 発光分布測定結果

3.3 モデル計算の評価

本研究ではモデル計算と顕著な違いが見られる FeXV23.39 nm と 24.38 nm に注目した。

ライン強度比は図 3.1 に示すように、それぞれ のラインについてガウシアンフィッティングを行 いその面積を強度として比を求めた。その際、2つ のラインの半値幅が一定となるようにフィッティ ングを行った。図 3.1 より Ie=14 mA から 23.39 nm のピークの高さが著しく増加していることが 分かる。

図 3.4 は大阪大学の山本氏の理論計算と今回測 定した強度比 23.39 nm/24.38 nm の電子密度依存 性をプロットしたものである。横軸が対数表示で あらわした電子密度、縦軸が強度比を示しており、 赤い点が今回の実験値、青い曲線がモデル計算の 計算結果を示している。また桃色の四角は先行研 究[2]の結果をプロットしたものである。なお、注 目したラインの詳細及び強度比や電子密度は表1, 表2の通りである。表1や図3.4より、Ie=12mA までは概ねモデル計算が実験を良く再現している ことが分かる。しかし Ie=13 mA 以降ではモデル 計算と実験結果に著しい差が見られる。Ie=13 mA 付近で立ち上がりを見せる 23.39 nm のラインが この様な著しい差を生み出している原因であると 考えられる。しかし 23.39 nm のラインが立ち上 がる原因は不明なため、今後の研究課題となって いる。

また先行研究 [2] のデータと今回のデータを比 較すると、電子密度に差があることが分かる。し かし、電子密度に対して強い依存性を持つことは 再現していると言える。

表 1 注目したラインの詳細 [3]					
Ion	Wavelength [nm]	Transition			
FeXV	23.3866	$3s3p \ ^{3}P_{2}$	$3s3d \ ^{3}D_{3}$		
	24.3794	$3s3p \ ^{1}P_{1}$	$3s3d \ ^{1}D_{2}$		

表2強度比の電子密度依存性

電子ビームエネルギー	電子密度	強度		強度比
Ie [mA]	$n_e [cm^{-3}]$	23.3866 nm	24.37940 nm	
10	2.6E + 10	17	34	0.50
12	3.4E + 10	18	36	0.50
13	3.8E + 10	32	41	0.78
14	4.2E + 10	25	35	0.71
15	4.6E + 10	30	30	1.0



図 3.4 FeXV のライン強度比の電子密度依存性

3.4 感度較正

今回用いたモデル計算はライン強度比と電子密 度の依存性を計算したものである。モデル計算の 評価を行う実験では目標とする価数のイオンによ る各ライン強度比を測定によって得られたスペク トルから求めていく。しかしながら、ここで分光器 における感度の波長依存性について考えなければ ならない。本研究で対称としていた FeXV の 23.39 nm と 24.38 nm におけるライン強度比では発光波 長が比較的近いので、感度の波長依存性はほぼ同 じものだと考えた。しかし同じ FeXV でも 24.38 nm と 28.42 nm では波長が離れている為に、強度 比を議論するためにはそれぞれのラインについて 感度較正を行わなければならない。

本研究では制動放射によるスペクトルを感度較 正に利用した。制動放射は

$$I_{\lambda} = \frac{Cc^2(\lambda - \lambda_{\min})}{\lambda^3 \lambda_{\min}}$$
(3.2)

と表す事が出来る。ここで C は原子固有の定数、cは光速度を示している。ここで電子ビームエネル ギーを 82.3 eV とすると λ_{\min} は Duane-Hunt の 法則

$$\lambda_{\min} = \frac{12.4}{E_{e}} [\text{\AA}] \tag{3.3}$$

より、 $\lambda_{\min} = 15.06 \text{ nm}$ と求めることが出来る。図 3.5 は実際に Ti ワイヤにエネルギー 82.3 eV の電 子ビームを入射して得られた制動放射スペクトル と制動放射の理論曲線をプロットしたものを示し ている。理論計算と実験で得たスペクトルを比較 すると、赤い理論線と青い実測線はスペクトルの 形に大きな違いが見られた。今回は20 nm 付近を 1と規格化しており、長波長側に行くにつれて感 度が減少していることが図 3.5 より分かる。つま り長波長側は感度が悪く、短波長側は感度が良い と言える。図 3.6 は Ee=500 eV のスペクトルに ついて実際に感度較正を行ったものである。今回 の実験では波長が離れたラインの強度比は求めな かったが、この感度較正の方法を用いて今まで議 論が出来なかったライン強度比についても測定を 行いたいと考えている。



図 3.5 観測した制動放射スペクトルと理論計算の比較



図 3.6 Ee=500 eV における感度較正前後のスペクトル

4 まとめと今後の展望

小型多価イオン源と斜入射型分光器を用いて鉄 多価イオンの極端紫外域発光線強度比の電子密度 依存性を測定した。

発光線強度は電子ビームエネルギーは一定に、 電子ビーム電流を変化させて測定した。同時に極 端紫外領域の発光分布も測定し、そこからトラッ プ領域の電子密度を測定した。測定結果より発光 線強度比の電子密度依存性を求め、モデル計算と の比較も行った。本研究では特にモデル計算と大 きな差が見られる FeXV スペクトルを観測し再現 性を確かめ、さらにモデル計算と違いが見られる 部分について詳細な測定を行った。

FeXV の 23.39 nm と 24.38 nm の発光線強度比 の電子密度依存は、実験とモデル計算で大きな差 があることが分かった。差が大きくなる部分の詳細 な測定によって、電子密度が $n_e = 4 \times 10^{10}$ cm⁻³ を超えるとモデル計算との差が大きくなる事が分 かった。しかし今回注目している FeXV23.39 nm の発光線強度が弱い為、実験誤差が非常に大きく なってしまった。そのため今後の研究では露光時 間を増やして測定する必要があると考えられる。

また本研究では制動放射スペクトルを用いて感 度較正を行った。本研究では実際に感度較正を行 うことはなかったが、今後の研究ではこの感度較 正の方法を用いて今まで議論が出来なかった発光 線強度比についても測定を行っていきたい。

参考文献

- [1] http://hinode.nao.ac.jp/po/eis/
- [2] N.Nakamura et al., ApJ, 739 (2011) 17
- [3] CHIANTI database